

干式氦检漏仪UL3000 Fab (PLUS)

INFICON UL3000 Fab氦气泄漏检测仪设计用于满足半导体应用中的泄漏测试需求。其具有灵活、机动、启动快、灵敏度高及可靠性高的特点，并且能够快速提供精确的测试结果。

经过改进的真空系统配备低维护真空泵，从大气压力开始便能检测泄漏。UL3000 Fab PLUS中的HYDRO-S软件能够消除水汽本底并加快泄漏测试的速度。

全新触摸显示屏能够从更远的距离显示测试结果和状态信息。用户引导式菜单结构可确保操作简便，即使不熟练的操作员也不例外。可通过智能手机或平板电脑对UL3000 Fab实现无线控制 - 而无需专用软件或App。可将通过按钮记录和存储的测试结果传输至其他存储媒体以进一步分析。

低重心、大滚轮、人体工学设计手柄和细长壳体使UL3000 Fab即使在狭小空间也具有良好的机动性。

选配的TC1000测试室可将UL3000转换为易于使用的密封件测试工作站TC1000测试室 [▶ 52]



用户优势

- 快速获得测量结果，节省大量时间
- 仪器可更方便地进入检漏区域
- 测量结果操作、分析和备份过程简便
- 适用于真空和吸枪泄漏检测
- 低运行和维护成本
- 坚固、耐脏、耐污染的真空系统
- 附件随设备提供
- 可及早检测出大规模严重泄漏

典型用途

泄漏测试对象

- 元件
 - 工艺室
 - 次组装件
- 用于
- 半导体设备
 - 平面显示设备
 - 密封电子元器件泄漏测试

规范

最小可检漏率 (真空模式)	< 5×10^{-12} mbar l/s
最小可检漏率 (吸枪模式)	< 5×10^{-8} mbar l/s
最大进气口压强	
大漏检测模式	1000 mbar
真空泵抽速	> 32 m ³ /h
对氦气抽速 (高灵敏度模式)	4 l/s
响应时间	< 1 s
启动时间	< 3分钟
可检测质量数	2、3、4 (H ₂ 、 ³ He、He)
离子源	2根带有氧化钽涂层的钨灯丝
测试接口	DN 25 KF
继电器	4
接口	2 x USB、以太网
电源电压	100至240 V, 50/60 Hz
功耗	典型值700 VA, 最大1500 VA
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1050 x 472 x 987 mm (413 x 186 x 389 in.)
重量	120 kg (265 lb.)
允许环境温度 (运行期间)	+10至+40 °C

订购资料

	订货号
ULTRATEST UL3000 Fab	550-200
ULTRATEST UL3000 Fab PLUS (HYDRO-S、SL3000吸枪管口)	550-250

附件

RC1000有线遥控器, 包括4 m线缆	560-310
RC1000WL无线遥控器, 包括无线发射器	560-315
SL200吸枪管线, 长4 m	140 05
带集成式显示屏的SL3000吸枪管 (仅适用于UL3000 Fab PLUS)	
- 长3 m	525-001
- 长5 m	525-002
- 长10 m	525-003
I/O1000模块 (图表记录器、RS232、RS485、Ethernet、数字I/O)	560-310
数据电缆 (I/O1000至UL3000 Fab (PLUS))	
- 0.5 m	560-334
- 5 m	560-335
- 10 m	560-340
TC1000测试室	551-005
氦气瓶架	551-201